クリエィティブミニマルファブ施設（CMF）装置リスト

2026/4/1現在

装置番号	施設（装置）名称	装置分類	設置部屋	資産番号	備考
CMF-001	ミニマル装置　マスクレス露光	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA4332-1	
CMF-002	ミニマル装置　電子ビームリソグラフィ（EB露光）	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA5358	
CMF-003	ミニマル装置　RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-1	
CMF-004	ミニマル装置　RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-2	
CMF-005	ミニマル装置　コータ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-3	
CMF-006	ミニマル装置　デベロッパ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-4	
CMF-007	ミニマル装置　SOD(P)	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-5	
CMF-008	ミニマル装置　SOD(B)	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-6	
CMF-009	ミニマル装置　拡散炉（B)	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-7	
CMF-010	ミニマル装置　拡散炉（P)	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-8	
CMF-011	ミニマル装置　イオン注入（P)	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-10	
CMF-012	ミニマル装置　イオン注入（B)	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-9	
CMF-013	ミニマル装置　PE-CVD(SiN)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-11	
CMF-014	ミニマル装置　スパッタ（Pt)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-12	
CMF-015	ミニマル装置　スパッタ（Au)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-13	
CMF-016	ミニマル装置　スパッタ（TiN)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-14	
CMF-017	ミニマル装置　スパッタ（Cr)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-15	
CMF-018	ミニマル装置　スパッタ（3元）	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-16	
CMF-019	ミニマル装置　スパッタ（汎用）	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-17	
CMF-020	ミニマル装置　マルチターゲットスパッタ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-18	
CMF-021	ミニマル装置　CMP	前処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-19	
CMF-022	ミニマル装置　マイクロプラズマエッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-20	
CMF-023	ミニマル装置　マルチボンダ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-21	
CMF-024	ミニマル装置　干渉膜厚計	評価	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-22	
CMF-025	ミニマル装置　金属膜厚計	評価	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-23	
CMF-026	ミニマル装置　微粒子スキャナ	評価	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-24	
CMF-027	ミニマル装置　デバイステスタ	評価	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	18AA6635-25	
CMF-028	ミニマル装置　RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6583-1	
CMF-029	ミニマル装置　Piranha 洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6589-1	
CMF-030	ミニマル装置　ウェットエッチャ（Al)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6599-1	

CMF-031	ミニマル装置　ウェットエッチャ（SiO2）	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6600-1	
CMF-032	ミニマル装置　ウェハ反転	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6601-1	
CMF-033	ミニマル装置　コータ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6602-1	
CMF-034	ミニマル装置　デベロッパ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6604-1	
CMF-035	ミニマル装置　マスクアライナ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6605-1	
CMF-036	ミニマル装置　集光加熱炉	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6606-1	
CMF-037	ミニマル装置　酸化炉	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6608-1	
CMF-038	ミニマル装置　レーザ加熱	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6610	
CMF-039	ミニマル装置　スパッタ（Al）	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6611	
CMF-040	ミニマル装置　スパッタ（TiN）	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6612-1	
CMF-041	ミニマル装置　TEOSプラズマCVD	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6632-1	
CMF-042	ミニマル装置　深掘エッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6638	
CMF-043	ミニマル装置　メタルエッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6640-1	
CMF-044	ミニマル装置　ダイボンダ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6641-1	
CMF-045	ミニマル装置　圧縮モールド	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6669-1	
CMF-046	ミニマル装置　レーザーアブレーション	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6670-1	
CMF-047	ミニマル装置　スパッタ（Ti）	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6671-1	
CMF-048	ミニマル装置　Cuメッキ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6673-1	
CMF-049	ミニマル装置　ウェットエッチャ（Cu）	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6674-1	
CMF-050	ミニマル装置　アセトン洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6676-1	
CMF-051	ミニマル装置　ボールマウンタ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6677-1	
CMF-052	ミニマル装置　リフロー炉	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6678-1	
CMF-053	ミニマル装置　プラズマクリーナ（デスミア加工）	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6679-1	
CMF-054	ミニマル装置　スパッタ（Cu）	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から寄附
CMF-055	ミニマル装置　集光加熱炉	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から寄附
CMF-056	ミニマル装置　RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から寄附
CMF-057	ミニマル装置　レジスト除去	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から寄附
CMF-058	ミニマル装置　Piranha洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から寄附
CMF-059	ミニマル装置　マスクレス露光	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から寄附
CMF-060	ミニマル装置　マイクロプラズマエッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	24AB0840	ミニマルファブ推進機構から寄附
CMF-061	ミニマル装置　深掘エッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	24AB7251	ミニマルファブ推進機構から寄附

CMF-062	ミニマル装置　RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	19AA2996	
CMF-063	ミニマル装置　コータ	処理	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	23AA4603	
CMF-101	電界放出形走査型電子顕微鏡	評価	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042040	18AA8644	
CMF-102	光学顕微鏡	評価	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6682	
CMF-103	触針式プロファイリングシステム	評価	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042040	17AA6687	
CMF-104	電気特性測定システム（プローバ、パラメータ・アナライザ、LCRメータ）	評価	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042020	17AA6714 17AA6715 17AA6716	一体として利用・課金
CMF-107	ドラフトチャンバー 1	処理環境	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042050	18AB1999-2	
CMF-108	ドラフトチャンバー 2	処理環境	臨海副都心センター第二別館　サイバーフィジカルシステム研究棟042050	18AB1999-3	